

34^{ème} séminaire INFOMAT

Métrologie et microscopie industrielles

Vendredi 11 novembre 2005

Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)
Rue Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel

En plus de la métrologie fondamentale, gardienne des étalons qui servent de référence aux utilisateurs situés en aval – laboratoires, entreprises et particuliers - la science de la mesure recouvre deux autres approches distinctes.

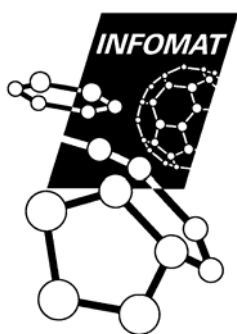
La métrologie légale, sous la tutelle des organismes officiels, propose un dispositif de contrôle pour certains instruments de mesure, dans un souci d'équité des transactions commerciales.

Enfin, la métrologie industrielle est, comme son nom l'indique, la science de la mesure en rapport avec les processus industriels. Demeurée longtemps empirique, elle fait aujourd'hui l'objet de prescriptions de plus en plus sévères. Elle répond notamment aux exigences de la politique qualité qui incite les entreprises, sous la pression de leurs donneurs d'ordre, à se conformer aux exigences des normes ISO en matière d'instruments de mesure et d'essai.

Pour les entreprises, la métrologie peut susciter bien des interrogations :

- Comment gérer le parc d'instruments de mesure et la fonction métrologique ?
- Gérer en interne ou en sous-traitance ?
- Comment choisir les instruments et les utiliser au mieux ?
- Quelles sont les contraintes réglementaires ou normatives pesant sur les instruments ?
- Comment étalonner et raccorder les instruments aux étalons nationaux ?

Le séminaire INFOMAT tentera, en présence des spécialistes du domaine de la métrologie industrielle, de répondre à ces diverses questions.



34^{ème} séminaire INFOMAT

Métrologie et microscopie industrielles

Vendredi 11 novembre 2005

Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)
Rue Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel

PROGRAMME

09h00	<i>Accueil et remise des documents</i>
09h15	<i>Ouverture du séminaire</i> Alain Vaucher / CENTREDOC
09h30	<i>Machine à mesurer 3D ultraprécise</i> Alain Küng / METAS, Berne (CH)
10h15 – 10h45	Pause café
10h45	<i>Confocal chromatique, interférométrie et vision en un seul instrument</i> Joseph Cohen-Sabban / STIL SA, Aix-en Provence (F)
11h30	<i>Caméra stéréo, système 3D</i> Michael Doppler / Leica Microsystems AG, Glattbrugg (CH)
12h15 – 13h45	Repas
13h45	<i>Scanning mécanique actif</i> Nino Talvacchia / Carl Zeiss AG, Feldbach (CH)
14h30	<i>Mesures optiques en production</i> Daniel Cosandey / TESA SA, Renens (CH)
15h15 – 15h45	Pause café
15h45	<i>Analyse des surfaces à l'aide de l'AFM et des fractales</i> Peter Walther / HES, Bienne (CH)
16h30	<i>Remarques finales</i> Alain Vaucher / CENTREDOC
17h00	Clôture du séminaire



34^{ème} séminaire INFOMAT

Métrie et microscopie industrielles

Vendredi 11 novembre 2005

Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)
Rue Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel

BULLETIN D'INSCRIPTION

Entreprise _____

Adresse _____

NPA-Localité _____

Téléphone _____

Fax _____

E-mail _____

Site web _____

Nom, prénom _____

Date et signature _____

Finance d'inscription (y compris documentation, repas, boissons)

Abonnés INFOMAT	Fr. 250.- / personne
Non-abonnés	Fr. 350.- / personne
Etudiants	Fr. 75.- / personne
TVA	non comprise
Paiement	sur facture

Inscription à retourner jusqu'au : **4 novembre 2005**



Inscription possible aussi sur notre site internet



CENTREDOC
Service *INFOMAT*
Jaquet-Droz 1
2007 Neuchâtel

Tél. 032 720 54 65 Fax 032 720 57 51
E-mail : infomat@centredoc.ch
www.centredoc.ch

CENTREDOC

